

中央研究院關鍵議題研究中心科研採購申請書

請購標的品名	案名：大氣原子沉積與化學氣相反應鍍膜系統一套 (案號: 114002463)
採購標的之性質種類	☒ 財物(包含儀器設備、試劑耗材、財物購置、訂製、租賃、權利使用等..) ☐ 勞務(包含專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、維修、訓練、勞力等)
規格及數量	1. 規格:詳如規格需求書 2. 履約期限: ¹⁴⁰ 收到第一期款次日起 ¹⁰⁷ 日曆日。 3. 付款方式: 付款應通過電匯轉帳方式支付給賣方。付款條款如下(分期付款): 第一期款契約價金 ^{45%} 60%: 契約成立後, 我方付款 ^{45%} 60%。 第二期款契約價金 ^{45%} 30%: 機器進行國際運輸之前, 我方付款 ^{45%} 30%。 第三期款契約價金 10%: 機器於指定位置安裝完成後, 30 天內我方付款 10%。 4. 保固期限: ☒ 自驗收合格之日起保固 <u>1</u> 年。 5. 交貨地點: 中央研究院南部院區 6. 本採購以 ☐ 內購 or ☒ 外購方式進行。
預估經費來源	科研環境領航計畫-淨零排放-基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃-關鍵中心(55EB次世代高效太陽能技術發展)
預估金額	新台幣4,025,500元整
採購理由說明	進行高品質氧化物薄膜於鈣鈦礦太陽能電池及相關基材上的沉積, 氧化物層作為緩衝層, 有助於提升串聯元件之性能。所選用之 Spatial Atomic Layer Deposition (SALD) 設備具備與傳統 ALD 技術相當之薄膜品質, 並能顯著提高沉積速率。另外, 該 SALD 系統亦具有高度靈活性, 可透過更換金屬前驅物以沉積多種其他類型之薄膜, 滿足更廣泛材料開發之需求。
逕行採購理由說明	NanoCompact-001型號為NanoPrint Innovations Ltd.所專屬開發及製造之系統, 具備其專利之氣體歧管設計, 可確保高度之薄膜均勻性, 為高性能薄膜應用之關鍵條件。此外, 其體積緊湊, 尤適用於實驗室空間受限之環境。該型號目前僅由NanoPrint Innovations Ltd.獨家供應。
檢附文件	1.報價單、2.規格需求、3.其他(獨家製造或供應)。

以下欄位由承辦人員填寫

採購方式	1. 辦理方式: ☒ 逕行採購、 ☐ 公告招標。 2. 議價方式: ☐ 由請購單位與廠商口頭議價、 ☒ 與廠商開會議價。 3. 是否訂定合約: ☒ 是、 ☐ 否。		
底價訂定	☒ 是, 請購設施建議底價。 ☐ 其他: ☐ 否, 小額採購(30 萬元)得不訂底價。		
請購人	採購人員	會計人員	單位主管
			